AKARIEOROMEMIEDIUMAND	
	For the second s
	苏大声: " " 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Patent Number: JP59193560
Publication date: 1984-11-02

Inventor(s): ARITA KOUICHIROU

Applicant(s): DAICEL KAGAKU KOGYO KK

Requested Patent: JP59193560

Application Number: JP19830068920 19830419

Priority Number(s):

IPC Classification: G11B7/24

EC Classification:

Equivalents:

١,

Abstract

PURPOSE:To obtain easily a stamper having excellent performance by forming successively an information transfer layer consisting of a material having high surface hardness and an intermediate layer consisting of a metal by a vacuum film forming method then forming a backing layer by an electroforming method. CONSTITUTION:An information transfer layer 2 consisting of a material having high surface hardness is formed by a vacuum film forming method on a matrix 1 for duplication and further an information transfer layer and a backing layer 4 are adhered thereto. An intermediate layer 3 playing the role of permitting electroforming of the backing layer is thereafter formed by a vacuum film forming method thereon in the same vacuum vessel. The information transfer layer and the backing layer adhered by the intermediate layer are stripped from the matrix for duplication and a stamper is obtd. Cr, Cr-Co alloy, corundum, TiN, TiC and SiC are used for the information transfer layer and Fe, Ni, Cu and Sn are used for the intermediate layer.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

7426-5D

昭59—193560

43公開 昭和59年(1984)11月2日

⑤Int. Cl.³
G 11 B 7/24
// B 29 D 17/00
G 11 B 3/70
11/00

②特

識別記号 庁内整理番号 B 8421—5D 6653—4 F 7247—5 D

発明の数 2

. 審査請求 未請求

(全 4 頁)

❷回転記録体用スタンパー及びその製造法

姫路市北新在家一丁目六番二号

顧 昭58--68920

の出 願 人 ダイセル化学工業株式会社

②出 願 昭58(1983) 4 月19日

堺市鉄砲町1番地

@発 明 者 有田孝一郎

個代 理 人 弁理士 古谷馨

明細 審

1 発明の名称

2 特許請求の範囲

- 1 表面硬度の高い物質よりなる情報転写層と、パッキング層と、これら二つの層を接着せしめる導電性を有し且つ酸化被膜が出来にくいか、出来ても除去し易い金属よりなる中間層から成り、情報転写層の厚みが 0.05 ~10 µ、中間層の厚みが 0.05 ~ 10 µ、パッキング層の厚みが 0.1 ~ 1.0 粒である回転配録休用スタンパー。
- 2 表面硬度の高い物質がクロム・クロム・コパルト合金・コランダム・選化チタン・炭化チタン又は炭化珪素であり、パッキング層がニッケル又は鍋からなり、中間層の金属が鉄ニッケル・鍋又は鍋である特許請求の範囲第1項配載の回転配録体用スタンパー。
- 5 レリーフ状の情報を担つた複製母型上に表

面硬度の高い物質からなる情報 転写層と、 導電性を有し且つ酸化被膜が出来にくいか。 出来でも除去し易い金属よりなる中間層を順法により形成させ、 しかる後パッキング層を電路法により形成させ、 上記中間層により形成させ、 上記中間層により形成させ、 上記中間層により形成で層とパッキング層を上記母型から剝離して得ることを特徴とする回転記録体用スタンパーの製造法。

- 4 装面硬度の高い物質がクロム・クロム・コパルト合金・コランダム・強化チタン・炭化チタンスは炭化珪素であり、パッキング層がニッケル又は銅からなり、中間層の金属が鉄、ニッケル・銅又は錫である特許請求の範囲第3項記載の回転記録体用スタンパーの製造法。
- 3 発明の詳細な脱明

本発明は回転配録体用スタンパー及びその製造法に関し、その目的とする所は情報転写性が すぐれ、且つ寿命の長いスタンパーを容易に得 ることにある。

ブラスチックスの円盤上に敬細な凹凸として

だちに行ない、かつ酸化膜除去の前処理を行な うことが窺ましい。

以下に本発明を実施例をもつて説明する。 実 施 例

鏡面研磨した直径 356 転・厚さ 6 転のガラス 円盤上に 6h1pley 社のポッ型レジスト A 2 1350 をスピンコーターで 700 Å 厚さに均一にコート し、ピーム径をしぼつた Ar レーザー光により巾 0.8 µ・ピッチ 2.5 µでスパイラル状に感光させた後現像して、深さ 700 Å . 巾 0.8 µ . ピッチ 2.5 µ の概を有する原盤を得た。この原盤上にクロム及びニッケルの二つのターゲットを有

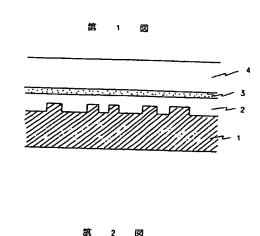
するマグネトロン式スパッタリング装置により、 クロム及びニッケルを順次それぞれ約 1000 Å 原盤上に成膜させた。との際クロムをスパッタ - した後、真空を破ることなくただちにニッケ ルをスパツターすることにより、クロム層(情 報転写層)とその上のニッケル層(中間層)と の中間に酸化物層が形成されるととがなく、と の両者は密着性よく積層された。かかるニッケ ル層で表面を覆われた原盤をただちに15 重量 **多のスルファミン酸溶液で処理した後、スルフ** アミン酸ニッケル(四水和物) 400 g/L . 塩化 ニッケル(六水和物) 5 8/4 . ほう酸 30 8/4. ピット防止剤 0.5 8/4 からなる電鈎浴に浸漬し、 垂直面に対し 45°の角度を保ちつつ電解ニッケ ルペレツトをいれたアノードポックスに対向し て回転せしめ、50 ℃で227 A·hr 通電せしめて、 電鶴を行なつた。しかる後に原盤より電鏑物を 剝離し、原盤の排が反転転写された厚さ 0.5 mm のスタンパーを得た。

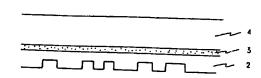
かくして得られたスタンパーを直径 527 麻.

厚さ 1.2 取のポリメチルメタクリレート樹脂のデイスクの射出成形に用い、一万ショットの成形の後、デイスクに転写された構形状を薄膜段差計により調べたところ、約 500 ショット目のデイスクにおいて、準形状に有意差が認められなかつた。

4 図面の詳細な説明

第1図はレリーフ状複製母型上にスタンパーが形成される状態を示す断面図、第2図は母型から剝離されたスタンパーを示す断面図である。1…複製母型、2…情報転写層、3…中間層、4…パッキング層





出願人代理人 古谷 整